

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

Seminar

15:00~16:10

2025
12/4
Thursday

次世代半導体工程を支える 大塚電子のソリューションご紹介

半導体のさらなる微細化が限界に近づく中、新たな技術アプローチとして中間工程を含むアドバンストパッケージ工程が注目を集めています。本セミナーでは、こうした業界の最新動向を踏まえ、大塚電子の計測・分析機器がどのように課題解決に貢献できるかをご紹介します。実際の測定事例や最新トピックスも交えながら、最先端のソリューションをわかりやすく解説します。

関連機器



顕微分光膜厚計
OPTM series



光波動場三次元顕微鏡
MINUK



ラインスキャン膜厚計®
【オフライン(ウェーハ対応タイプ)】



ゼータ電位・粒子径・
分子量測定システム
ELSZneo

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。
下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/entry/eventid/523>



ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。

大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp